AU 1363 486

JP 361020493 B2 MAY 1986

86-160500/25 L01 NITE 01.08.78 NIPPON TELEG & TELEPH *J8 6020-493-B 01.08.78-JP-093105 (22.05.86) C03b-20 C30b-37/01	L(1-F2, 1-F3F)
Appts, used to produce optical fibre preform rod - has two reducers to reduce rod dia, and gas seal between reducers (J5 13.2.80)  C86-068906	·
Appts. to produce preform rod of optical fibre for optical communications. It has 2 reducers to reduce dia, of rod and gas seal to seal space between reducers, allowing reducing dias, to be selected. (J55020260-A) (6pp Dwg.No.0/6)	
	-
•	

© 1986 DERWENT PUBLICATIONS LTD.
128, Theobalds Road, London WC1X 8RP, England
US Office: Derwent Inc. Suite 500, 6845 Elm St. McLean, VA 22101
Unauthorised copying of this abstract not permitted.

LÜ

		,	
	•		

#### 許 報(B2) ⑫特 公

昭61 - 20493

⑤Int Cl.⁴

識別記号

厅内整理番号

**❷** 公告 昭和61年(1986)5月22日

C 03 B 37/018 . // C 03 B 20/00 G 02 B 6/00

8216-4G 7344-4G S - 7370 - 2H

発明の数 1 (全6頁)

光ファイバ母材連続製造装置 ❷発明の名称

> ②特 昭53-93105

昭55-20260 ❸公

22出 昭53(1978)8月1日 ❸昭55(1980)2月13日

⑦発 眀

establish in which seeks and will be

文 明 茨城県那珂郡東海村大字白方字白根162番地 日本電信電

話公社茨城電気通信研究所内

昭

茨城県那珂郡東海村大字白方字白根162番地 日本電信電

話公社茨城電気通信研究所内

和 憲

茨城県那珂郡東海村大字白方字白根162番地 日本電信電

話公社茨城電気通信研究所內

願 日本電信電話株式会社 仍出

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号

砂代 理 暁秀 弁理士 杉村 人 査 官 松 本

外1名

1

## - 切特許請求の範囲

1 火炎加水分解によつて光ファイバ用多孔質焼 結母材を作製し、透明ガラス化炉において透明な 、光フアイバ用母材を連続的に製造する光フアイバ 用母材の製造装置において、前記透明ガラス化炉 5 の上端部に任意の径を選択できる2個の絞り器 こと、この2個の絞り器の間をシールするガスシー ルおよびガラス母材の外径測定装置を設け、前記 2個の絞り器と外径測定装置を連動させるととも に、前記ガスシールでガラス母材に無接触で炉内 10 ばならない。すなわち第1図において、高温炉3 と炉外の雰囲気を完全にしや断して光ファイバ用 母材を連続的に製造することを特徴とする光ファ イバ母材連続製造装置。

#### 発明の詳細な説明

するものである。

近年通信用光ファイバの研究が各所において活 発に行われ、光ファイバ用母材の連続製造法も確 立されるまでに至つている。この母材の連続製造 い素ゲルマニウム、りん、ほう素などのハロゲン 化物を酸化させて、それぞれの酸化物粉末を回転 軸上に付着成長させ、50㎜φ~100㎜φの棒状の 酸化物体2を作製し、次いでこの酸化物体を高温

炉透明ガラス化炉3に順次引き上げて脱泡透明ガ ラス化を行い、高温炉の上部から連続的に光ファ イバ用母材4を引き上げる。

2

この工程において、透明ガラス化は約1600°C~ 1800℃の温度範囲で行われるので、発熱体には主 に高温度が得られ易い高純度カーボンが使用され ている。カーボンは、大気中で加熱されると著し く消耗するので、カーボンを発熱体とする場合に は、炉内雰囲気を完全な還元雰囲気に保たなけれ から光フアイバ用母材 4 が引き上げられる際、高 温炉3の上部出口から大気が炉の内部に侵入する のを防ぐような炉の構造にしなければならない。

このように炉内と炉外を完全にシールする方法 本発明は光フアイバ用母材の連続製造装置に関 15 として、従来は第2図に示すような製造装置を用 いて行われていた。この方法は、カーボンフェル トまたはガラスウールなどを円板状に形成した断 熱材215を、位置決め金具213,214の間 に固定し、順次引き上げられる光フアイバ用母材 方法を第1図に示す。酸水素バーナ1によつてけ 20 4の表面に断熱材215を接触させて炉内と炉外 のシールを行う。

> しかしこのシール方法では、次の問題点があつ た。

> (1) 光ファイバ用母材に物理的な力が加わるの

で、酸化物粉末が付着・成長する酸化物成長面 がゆらぎ、所望の屈折率分布が得られなくなる (光学特性が劣化する)。

- (2) 製造される光ファイバ用母材の外径の変化に 対応できない。
- (3) 断熱材によつて光ファイバ用母材の表面が汚 染される。

前記諸問題を解決するために、第3図に示す製 造装置を用いて母材の連続製造が行われている。 を設け、この保護管211の長さまで連続製造を 行う方法がある。この方法によれば前記諸問題は 解決されるが、保護管の長さによつて製造される 母材の長さも決められてしまい、実質的な母材の 連続製造ではない。

and the state of the same

Large Leave Carlot

本発明は、光フアイバ用母材が順次引き上げら れる高温炉の上部出口において、光ファイバ用母 材に対して無接触で、かつ炉内雰囲気と炉外雰囲 気を完全にしや断することを特徴とし、その目的 は、従来の諸問題を解消し、光ファイバ用母材の 20 安定な連続製造を提供することにある。以下、図 面により本発明を詳細に説明する。

第4図は本発明の一実施例図であつて、30は 高温炉本体(透明ガラス化炉本体)で、210は 発熱体であり高純度カーボンを使用した。2は作 25 器 28'までの距離に応じた時間だけ遅延させ、 製した酸化物体であつて、所定の速度で引き上げ られ、発熱体210によつて透明な光ファイバ用 母材 4 になる。 2 1 は光源 (例えばYACレーザ 等)、22はレンズの組み合わせで構成される光 学系、23は受光部、24は制御回路、25は記30よりも高くなるようにガス流量を設定し、作製さ 憶回路、26はモータ、27はフアイバである。 2 8 は 15㎜ φ から 45㎜ φ までの範囲で任意の内径 が得られる絞り器で、その原理を第5図により説 明する。

径を得るためのばねであつて、図示してないが12 枚使用した。各ばねの両端にピン32,33を設 け、ピン32は固定リング34の同心円上にある ピン穴35にさし込み、このピンを支点としてば ね31が回転する。第5図bは絞り器の側面図 40 で、回転リング36は第5図aには示していない が、第5図bからわかるように、ばね31の上に 回転リング36が設けられる。ピン33は回転リ ング36に支えられ、回転リング36を回転する

ことによつてばね31はピン32を支点として回 転する。この結果12枚のばねの重なりで絞り器の 中心に近似的な円ができ、回転リング36の回転。 角により、その円の直径は大きくなつたり小さく 5 なつたりする。

4

次に本発明の動作を第4図により説明する。 光源22から出射された光ビームは、フアイバ 27 (石英形ファイバ、多成分ファイバ、プラス ) チックファイバ等)によつて光学系22に導かれた。 すなわち高温炉3の上部に円筒形の保護管211 10 る。光学系22から出射した光ビームが光ブアイ バ用母材 4 によつてしや断されるように光学系 2 2を調整する。光学系22から出射した光ビーム を受光部23で受光して、ここで電気信号の大小 に変換し、制御装置24によつて光ファイバ用母 15 材の外径変動に対応する電気信号を取り出し、そ の電気信号を記憶回路25に記憶する。記憶回路 25によつて光ファイバ用母材4の外径変動測定 位置から絞り器28までの距離に応じた時間だけ 電気信号を遅延させた後、モータ26に電気信号 を送り、この電気信号によつてモータ26を作動 させ、連続的に引き上げられる光ファイバ用母材化 4の外径に相当する分だけ絞り器28の内径を変 動させる。

> また同一電気信号を外径変動測定位置から絞り、 前述の原理と同じようにモータ26'を作動さ せ、絞り器28′の内径を変化させる。

なお絞り器28と28′の間にガス導入部29 を設け、両絞り器間の圧力が炉内圧および外気圧 れる光ファイバ用母材と絞り器との間との間隔を ガスシールする。

このガスシールで前述のように、炉内と炉外の 雰囲気をしや断する動作によつて、順次引き上げ 第5図aは絞り器の正面図で、31は任意の内 35 られる光ファイバ用母材の外径が変化しても、母 材に無接触で、かつ完全に炉内と炉外の雰囲気を しや断することができる。

> 以下に本発明装置を使用した実験例について述 べる。

> 光フアィバ用母材を60㎜/時間の速度で引き上 げ、外径測稚装置によって光ファイバ用母材 4の 外径を測定した。外径測定位置から絞り器28ま での距離は30㎜、絞り器28′までの距離は50㎜ にそれぞれ設置した。つまり光ファイバ用母材の

引き上げ速度は60㎜/時間であるので、外径が測 定された箇所が絞り器28に達する時間は30分、 、同じく絞り器28′に達する時間は50分である。

光ファイバ用母材の外径変動に対する電気信号 をこの時間分だけ遅延させた後、両絞り器に連動  $5~{
m Hz/m}$ から230 ${
m MHz/m}$ までの "バラッキ" があ したモータ26,26′に電気信号を送るように 記憶回路25を調整した。両紋り器は、測定され ・ た母材外径よりも2 m大きく開くようにし、両絞 り器間のガス導入部からArガスを5 ℓ/分流し て両絞り器の圧力を炉内圧力および外気圧力より 10 た。 も高くして、炉内雰囲気と炉外雰囲気をしや断し た。、

第6図に時間変化に対する母材外径の変動と絞 り器28,28'の内径変化を示す。Aは母材外 径測定位置で測定された母材外径の変動で、Bは 15 定し、その径に応じて2個の絞り器の開き径をそ 絞り器28の内径の変化、Cは絞り器28′の内 径の変化である。

第6図からわかるように、本発明の装置によっ て母材外径が変化しても、二つの絞り器の内径は ・この実験では26時間の母材連続製造を行つたが、 カーボン発熱体に消耗は見られず、炉内と炉外の 雰囲気は完全にしや断されていた。製造した外径 21mm φ、長さ140cmの光フアイバ用母材のうち、 両端部と中心部の3箇所をファイバ化して、損失 25 の装置として有効である。 特性の長手方向の変動を調べた。この結果、波長 0.85 μ mでの損失は、3本の光ファイバとも2.3 ~2.4dB/㎞であり、長手方向の損失変動は見ら れなかつた。また光フアイバ用母材の屈折率分布 によつて変化する光ファイバの帯域特性は、10km 30 本発明に用いる絞り器の正面図および側面図、第 の光ファイバについて測定した結果、600MHz/ 畑以上の値が得られ、屈折率分布の長手方向の変 動もなかつた。

比較のため、第2図と第3図に示した従来の装 置を用いた方法によつて母材の連続製造を行つた 35 ス化炉)、4 ……光ファイバ用母材 (ガラス母 ところ、第2図に示した従来の装置では、回転す る光フアイバ用母材に接触する断熱材が除々に消 耗してしまい、連続製造開始から6時間後には、 光ファイバ用母材と断熱材との間に2㎜以上の間. 隙ができてしまい、10時間の連続製造しかできな 40 器、29 ……ガス導入口、30 ……高温炉本体 かつた。母材の製造を終了した後、カーボン発熱 体を調べたところ、発熱体は消耗しており、初期 抵抗値 $0.06\Omega$ が終了後では $0.18\Omega$ と大きくなつて いた。

製造した母材の表面には断熱材が付着してお り、この母材を線引きして10㎞の光フアイバを製 造した結果、損失特性は波長0.85μmで2.6dB/ 畑から4.2dB/畑であり、また帯域特性は85M り、両特性とも大きな変動があつた。

6

第3図に示した従来の装置を用いた方法では、 損失特性、帯域特性とも良好な結果が得られた が、母材の連続製造は8時間しか実施できなかつ

以上説明したように、本発明の光ファイバ用母 材連続製造装置は、任意の径が得られる絞り器を 2個設け、その間をガスシールしておき、作製さ れた透明な光ファイバ用母材の外径を光学的に測 れぞれ変化させるので、透明な光ファイバ用母材 に無接触で炉内と炉外を完全にしや断できる利点 がある。このため、製造される光ファイバの損失 特性、帯域特性とも、長手方向に極めて変動が少 母材外径の変化に応じて変化することがわかる。20 ない特性を得ることができる。またカーボン発熱 体が消耗されないので、長時間の連続製造が実施 できる。さらに本発明は、市販されているカーボ ンを発熱体とする抵抗炉において、炉内に試料を 連続的に挿入する場合、炉内の雰囲気を保つため

### 図面の簡単な説明

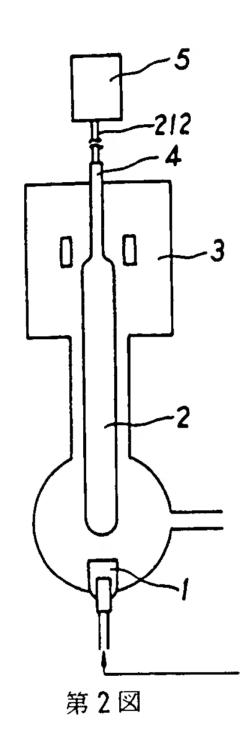
第1図、第2図および第3図は従来の光ファイ バ用母材の製造装置の概略構成図、第4図は本発 明装置の一実施例図、第5図aおよび第5図bは 6 図は光ファイバ用母材の外径の変動と絞り器の 内径変化を示す図である。

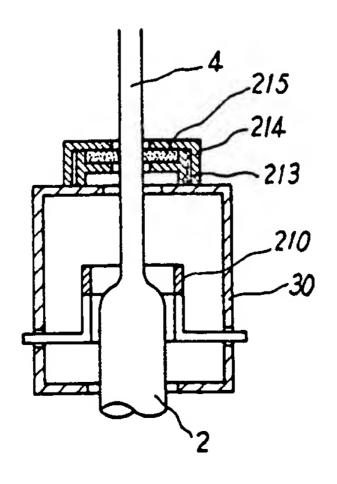
1 ……ガラス微粒子合成トーチ(酸水素バー ナ)、2 ……酸化物体、3 ……高温炉(透明ガラ 材)、5……回転引き上げ装置、21……光源、 2 2 ……光学系、2 3 ……受光部、2 4 ……制御 装置、25……記憶回路、26,26′……モー タ、27……光フアイバ、28, 28′……絞り (透明ガラス化炉本体)、31……羽、32,33 ……ピン、3**4…**…固定リング、35……ピン 穴、36……回転リング、210……発熱体、2 11……保護管、212……出発棒、213,2

7

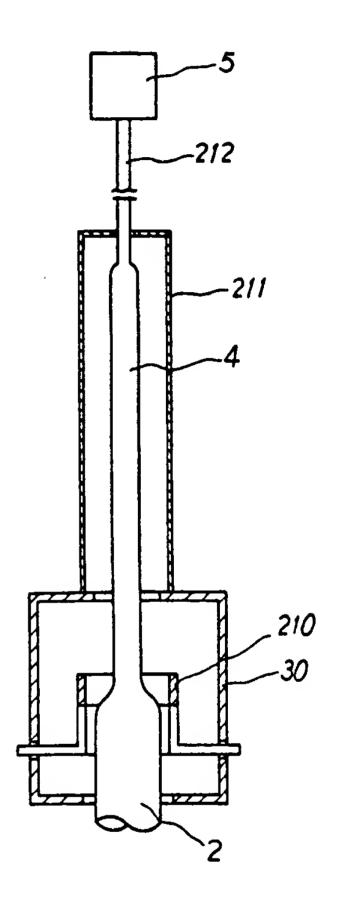
# 14……位置決め金具、215……断熱材。

第1図

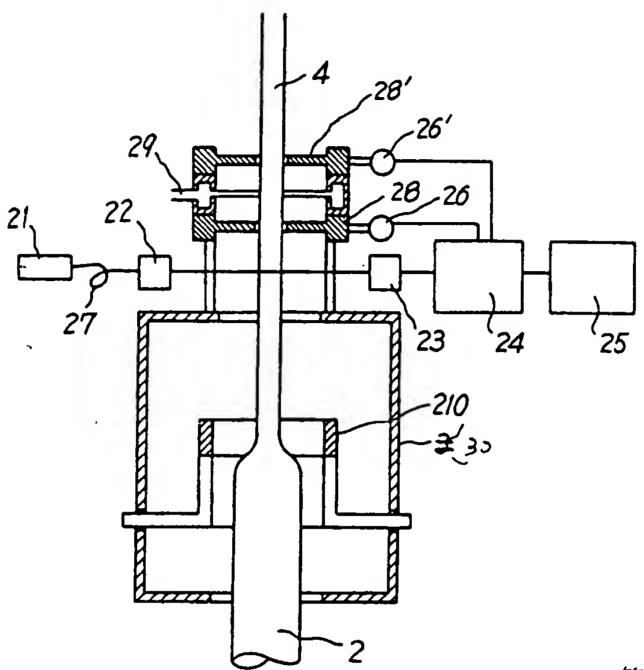




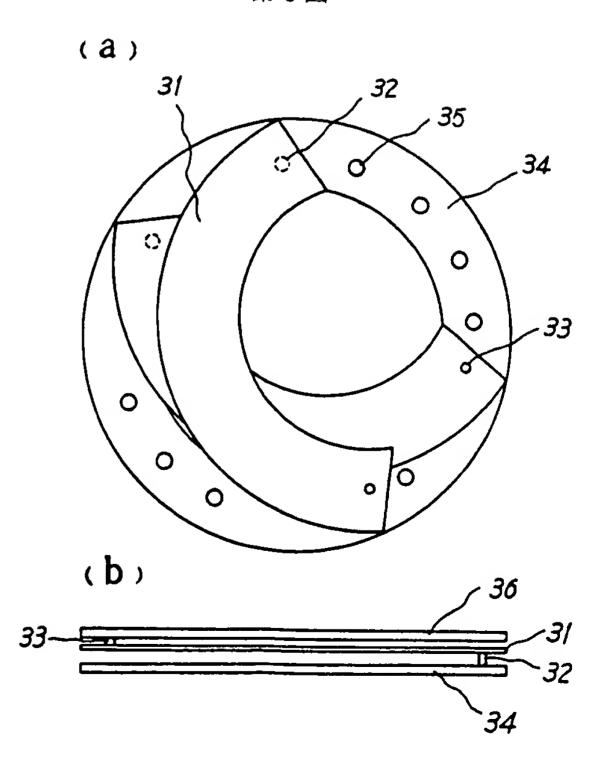
第3図



第4図



第5図



第6図

(6)

